

イオンミリングと 発光分光分析の 基礎と最新手法のご紹介

参加費
無料



QRコードより
WEBフォームにて
お申し込みください。

日頃より、全学の共用研究設備・機器をご活用いただき誠にありがとうございます。
この度、イオンミリングと発光分光分析のセミナーを実施いたします。
当日は最新技術や皆様の研究に役立つアプリケーションをご紹介いたします。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

岐阜大学 機器分析分野

日時

開催場所

① 6/18 (木) 13:00-16:30

岐阜大学 〒501-1193
岐阜県岐阜市柳戸1-1
総合研究棟Ⅱ 1階 機器分析 セミナー室
定員：各セミナー30名（事前申込み優先）

② 6/19 (金) 9:00-13:45

① 6/18 スケジュール

- | | | |
|-------|-------------|--------------------------------|
| [①-1] | 13:15~13:55 | イオンミリング装置を用いたSEMの前処理手法のご紹介 |
| [①-2] | 14:00~14:25 | CMOS型 固体発光分析装置の基礎と機能性金属の分析例 |
| [①-3] | 14:45~15:10 | ICP発光分析の基礎と最新アプリケーション |
| [①-4] | 15:15~15:40 | 分光分析の基礎と固体試料の測定例 |
| [①-5] | 15:45~16:30 | 既設イオンミリング操作説明、ハンドヘルド蛍光X線分析装置展示 |
- ※途中休憩を含みます。

▶ 各セミナーごとにご入退室いただけます。ご希望のセミナー時間に合わせてお申し込みください。

② 6/19 スケジュール

- | | | |
|-------|-------------|--------------------------------|
| [②-1] | 9:15~9:40 | ICP発光分析の基礎と最新アプリケーション |
| [②-2] | 9:45~10:10 | 分光分析の基礎と固体試料の測定例 |
| [②-3] | 10:30~10:55 | CMOS型 固体発光分析装置の基礎と機能性金属の分析例 |
| [②-4] | 11:00~11:25 | イオンミリング装置を用いたSEMの前処理手法のご紹介 |
| [②-5] | 13:00~13:45 | 既設イオンミリング操作説明、ハンドヘルド蛍光X線分析装置展示 |
- ※途中休憩を含みます。

▶ 各セミナーごとにご入退室いただけます。ご希望のセミナー時間に合わせてお申し込みください。

お問合せ先

オザワ科学株式会社 岐阜営業所

担当：大橋正照 Mail：ohashi@ozawasc.co.jp TEL：080-6971-6792